



边 裁 佑

YEAR OF PRACTICE

- 2009年 ~ 至今

EDUCATIONAL BACKGROUND

- 首尔大学 机械工程系 (1999)

ADMISSIONS / AFFILIATIONS

- 辨理士 (2009, 第46届)
- 大韩辨理士协会 (KPAA)

TECHNICAL EXPERTISE

- 半导体设备、半导体制造工艺
- AI, AR/VR, 自动化设备、显示设备、通用机械、汽车零部件、发动机、控制等

CONTACT

- Tel: 02-6714-1134
- Email: bjw@nampat.co.kr

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 半导体和LCD工艺/仪器领域的国内外专利案件处理 (说明书, 意见书及审判)
- 通用机械/汽车配件/发动机领域的专利案件处理 (审判和诉讼)
- 测量/控制/半导体制造设备等领域的专利案件处理 (审判和诉讼)